

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.16 «ТЕХНОЛОГИИ МЭМС»

Направление подготовки (специальность)	28.03.02 «Наноинженерия»
Направленность (профиль, специализация)	«Инженерные нанотехнологии в приборостроении»
Квалификация (степень) выпускника:	бакалавр
Форма обучения	очная
Срок освоения образовательной программы	4 года
Год начала подготовки	2017

Цель изучения дисциплины:

формирование у обучающихся знаний о базовых технологических процессах и маршрутах изготовления микроэлектромеханических систем (МЭМС).

Задачи изучения дисциплины:

знать особенности изготовления микромеханических датчиков, связанные с получением подвижных чувствительных элементов: методы анизотропного травления (жидкостного и плазменного) конструктивных слоев МЭМС и размерного стоп-травления, технологии объемной и поверхностной микрообработки, технология LIGA, технологии SOIMUMPs и PoliMUMPs и др.

Перечень формируемых компетенций:

ПКВ-2 — Готовность к применению современных технологических процессов и технологического оборудования в производстве приборов и устройств микро- и наноэлектроники.

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 5

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен